

CC800[®] HiPIMS

HiPIMS高功率脉冲磁控溅射



涂覆区域, Ø x h	[mm]	Ø400 x 400
转台, Ø x Ø 行星*数量	[mm], 个	Ø400 x Ø130 x 6 1
阴极	个, [mm]	6 x 500 (其中4个用于HiPIMS / DC和2个用于DC; 所有阴极都装有挡板)
最大装载尺寸, Ø x h	[mm]	Ø400 x 800
杆刀装炉量 Ø6 mm x 60 mm	支	1,800
刀片装炉量, 12,7 mm x 3,5 mm	片	4,920
最大装载重量	[kg]	250
沉积速率	µm/h	纯HiPIMS模式下, 2 µm/h
3µm FerroCon [®] 涂层循环时间 *	[h]	4.5
工艺技术		带离子增强技术的HiPIMS和溅射工艺, 所有CemeCon已有涂层均可沉积
基体预处理 (等离子刻蚀)		Booster, MF和HiPIMS蚀刻
导电涂层		yes
导电涂层		yes
非导电基体		yes
连接负载	[kW]	80
3µm FerroCon [®] *每炉次耗电量	[kWh]	120
外形尺寸 (w x l x h)	[mm ³]	1,450 x 3,350 x 2,200

* 10mm铣刀纯HiPIMS涂层, 满载荷, 三重旋转